# Острая фокусировка лазерных пучков с посекторно неоднородной поляризацией

С.С. Стафеев<sup>а,б</sup>, А.Г. Налимов<sup>а,б</sup>, М.В. Котляр<sup>6</sup>, Л. О'Фаолейн<sup>в</sup>, В.В. Котляр<sup>а,б</sup>

<sup>а</sup> Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 443001, ул. Молодогвардейская 151, Самара, , Россия

<sup>6</sup> Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Московское шоссе, 34, Самара, Россия <sup>6</sup> Школа физики и астрономии, Университет Сент Эндрюса, КҮ16 9SS, Великобритания

#### Аннотация

Численно рассмотрена фокусировка оптического вихря с посекторной азимутальной поляризацией. Оценено влияние секторности на результаты фокусировки. Было показано, что использование 6-секторного пучка приводит к незначительному расхождению в размерах фокусного пятна по сравнению с идеальным пучком – разница в диаметрах по полуспаду интенсивности не превышает 0,001λ. При использовании 4-секторного пучка расхождение в диаметрах не превышает 0,028λ. Экспериментально исследовалась фокусировка лазерного излучения с длиной волны 633 нм, прошедшего через четырехсекторный пропускающий азимутальный поляризатор с фазовым сдвигом, зонной пластинкой Френеля с фокусным расстоянием 532 нм. Экспериментально измеренные размеры фокусного пятна составили 0,46 и 0,57 от длины волны фокусируемого света.

Ключевые слова: острая фокусировка; оптический вихрь; азимутальная поляризация; зонная пластинка Френеля

# 1. Введение

Цилиндрические векторные пучки (пучки, в которых направление поляризации имеет радиальную симметрию) в оптике в настоящий момент активно изучаются [1]. При этом в последнее время отмечен рост к исследованию фокусировки азимутально и радиально поляризованных оптических вихрей [2,3]. Существует несколько способов получения цилиндрических векторных пучков, в которых направление поляризации изменяется не непрерывно, а посекторно. Такие пучки с посекторной азимутальной или радиальной поляризацией могут быть получены с помощью волновых пластинок [4,5], нелинейных оптических кристаллов [6], поляризующих пленок [7] и субволновых решеток [8].

Острая фокусировка цилиндрических пучков, поляризованных посекторно (азимутально и радиально), была рассмотрена ранее в [9], однако острая фокусировка азимутально поляризованного оптического вихря ранее не рассматривалась.

В данной работе было оценено влияние секторности азимутально поляризованного оптического вихря на результаты фокусировки и экспериментально рассмотрена фокусировка света, прошедшего через четырехсекторный субволновый азимутальный поляризатор с фазовым сдвигом. Было показано, что использование 6-секторного пучка приводит к незначительному расхождению в размерах фокусного пятна по сравнению с идеальным пучком – разница в диаметрах по полуспаду интенсивности не превышает 0,001 Л. При использовании 4-секторного пучка расхождение в диаметрах не превышает 0,028 А. Экспериментально исследовалась фокусировка лазерного излучения с длиной волны 633 нм, прошедшего через четырехсекторный пропускающий азимутальный поляризатор с фазовым сдвигом, зонной пластинкой Френеля с фокусным расстоянием 532 нм. Экспериментально измеренные размеры фокусного пятна составили 0,46 и 0,57 от длины волны фокусируемого света.

#### 2. Влияние секторности пучка на результаты фокусировки

Моделирование выполнялось с помощью формул Ричардса-Вольфа. Считалось, что азимутально поляризованный свет с длиной волны 532 нм проходит через секторную фазовую пластинку после чего фокусируется зонной пластинкой Френеля с числовой апертурой NA=0,95. Пример моделируемой задачи показан на рис. 1.



Результаты моделирования показаны на рис. 2-4. На рис. 2 показана фокусировка пучка, состоящего из четырех секторов. На рис. 3 – из шести секторов. Для сравнения на рис. 4 показана фокусировка идеального азимутально поляризованного оптического вихря.



Рис. 2. Распределение в фокусном пятне интенсивности и отдельных составляющих интенсивности: I<sub>x</sub> (a), I<sub>y</sub> (б), I<sub>z</sub> (в), I (г), при фокусировке 4-секторного азимутального пучка, прошедшего 4-секторную СФП.



Рис. 3. Распределение в фокусном пятне интенсивности и отдельных составляющих интенсивности: I<sub>x</sub> (а), I<sub>y</sub> (б), I<sub>z</sub> (в), I (г), при фокусировке 6-секторного азимутального пучка, прошедшего 6-секторную СФП.

Информационные технологии и нанотехнологии - 2017 Компьютерная оптика и нанофотоника



Рис. 4. Интенсивность в фокусном пятне I<sub>x</sub> (a), I<sub>v</sub> (б), I (в) при фокусировке идеального азимутально-поляризованного оптического вихря.

Из сравнения рис. 2 и 3 с рис. 4 видно, что секторно-поляризованный пучок, прошедший через секторную СФП в отличие от идеального азимутально поляризованного оптического вихря содержит продольную компоненту напряженности электрического поля. Хотя вклад ее в формирование фокуса мал – для 4-секторного пучка максимум поперечной компоненты примерно в 21 раз превышает максимум продольной, а для 6-секторного – примерно в 80 раз. На рис. 5 показана относительная погрешность расхождения интенсивности в фокусе идеального пучка (*I*<sub>ideal</sub>) и секторно поляризованного (*I*<sub>quasi</sub>), вычисленная как |*I*<sub>ideal</sub>-*I*<sub>quasi</sub>|/max(*I*<sub>ideal</sub>).



Рис. 5. Ошибка в фокусе, вычисленная как |I<sub>ideal</sub>-I<sub>quasi</sub>//max(I<sub>ideal</sub>) для (a) 4-секторного и (б) 6-секторного азимутально-поляризованного пучка.

Максимум погрешности на рис. 5a не превышал 18%, а на рис. 56 - 9%. Размеры получившихся фокусных пятен приведены в таблице 1. Из таблицы 1 видно, что использование 6-секторного пучка практически не влияет на результат фокусировки – расхождение в размерах фокусного пятна по полуспаду интенсивности, вызванное асимметрией, не превышает 0,001 $\lambda$ . Для 4-секторного пучка расхождение не превышает 0,028 $\lambda$ .

Таблица 1. Значения диаметров фокусного пятна по полуспаду интенсивности

Количество секторов	$FWHM_{min} \left( \lambda \right)$	FWHM <sub>max</sub> ( $\lambda$ )
4 сектора	0,458	0,490
6 секторов	0,462	0,463
Идеальный азимутально поляризованный вихрь	0,462	0,462

#### 3. Пропускающий четырехсекторный поляризатор с фазовым сдвигом

#### 3.1. Изготовление пропускающего четырехсекторного поляризатора с фазовым сдвигом

Для дальнейшего исследования острой фокусировки нами был предложен микрополяризатор с полуволновым сдвигом для преобразования линейной поляризации в азимутальную. Такой микрополяризатор содержит четыре зоны с углами наклона линий субволновых решеток  $-60^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$ ,  $-60^{\circ}$ ,  $60^{\circ}$  (рис. 6). Период решеток равен 230 нм, ширина ступеньки 138 нм, ширина канавки 92 нм. Материал решётки - кремний (Si), высота рельефа решётки 130 нм. Решётка рассчитана на длину волны 633 нм, комплексный показатель преломления кремния при расчете выбирался равным n = 3,87 - 0,016i. Размер изготовленного поляризатора  $100 \times 100$  мкм.

Микрополяризатор был изготовлен по технологии электронной литографии. На поверхность аморфного кремния (130 нм) (a-Si) на прозрачной пирексной подложке, нанесли 320 нм резиста (ПММА), который закрепили при температуре 180 °C. Величина толщины резиста (320 нм) была подобрана оптимальным образом. Во избежание формирования заряда на поверхности образца, на него было распылено 15 нм золота. Электронным лучом с напряжением 30 кВ была написана картина 4-секторной решётки-поляризатора на поверхности резиста. Для проявления образца, использовался раствор воды и изопропанола в соотношении 3:7. При этом процессе слой золота был полностью смыт с поверхности ПММА. Трансформирование шаблона решётки-поляризатора с резиста на аморфный кремний было осуществлено с помощью реактивного ионного травления с использованием газов CHF<sub>3</sub> и SF<sub>6</sub>. Толщина резистора была подобраны таким образом, чтобы он смог защитить части картины во время травления 130 нм аморфного кремния. Аспектное отношение скоростей травления материала и маски было найдено 1:2,5.



Рис. 6. АСМ изображение центральной части 4-секторного пропускающего поляризатора. Шкала показывает глубину рельефа в нм.



Экспериментально исследовалась фокусировка зонной пластинкой Френеля с фокусным расстоянием f = 532 нм пазерного излучения с длиной волны  $\lambda = 633$  нм прошедшего через 4-секторный преобразователь поляризации. На рис. 7 показана схема проведенных измерений. В данном эксперименте линейно-поляризованное лазерное излучение от гелий-неонового лазера с длиной волны 633 нм попадало через волоконно-оптическую транспортную систему на подложку с расположенными на ней 4-СПП. Положение пятна и его размеры на зонной пластинке контролировались путем смещений зеркала  $M_1$ . Прошедшее через 4-СПП излучение фокусировалось зонной пластинке микроскопом Интегра Спектра (выделен штриховой линией на рис. 7) с помощью четырёхгранного пирамидального кантилевера *C*.



Рис. 7. Схема проводимого эксперимента. М<sub>1</sub>, M<sub>2</sub> - зеркала, O<sub>1</sub> - 100× объектив, С - кантилевер, S - спектрометр, CCD - камера.

Измерения на сканирующем ближнепольном оптическом микроскопе показали, что на расстоянии 200-250 нм от поверхности ЗП формируется фокусное пятно, а его размеры по полуспаду интенсивности составляют 0,46λ и 0,57λ (рис. 8). При этом численное моделирование фокусировки методом FDTD показало, что размеры пятна формируемого поперечной составляющей напряженности электрического поля были равны FWHM = 0,42λ и FWHM = 0,59λ.



Рис. 8. Распределение интенсивности в фокусе измеренное на сканирующем ближнепольном микроскопе.

#### 4. Заключение

В данной работе было оценено влияние секторности азимутально поляризованного оптического вихря на результаты фокусировки и экспериментально рассмотрена фокусировка света, прошедшего через четырехсекторный субволновый азимутальный поляризатор с фазовым сдвигом. Было показано, что использование 6-секторного пучка приводит к незначительному расхождению в размерах фокусного пятна по сравнению с идеальным пучком – разница в диаметрах по полуспаду интенсивности не превышает 0,001λ. При использовании 4-секторного пучка расхождение в диаметрах не превышает 0,028λ. Экспериментально исследовалась фокусировка лазерного излучения с длиной волны 633 нм, прошедшего через четырехсекторный пропускающий азимутальный поляризатор с фазовым сдвигом, зонной пластинкой Френеля с фокусным расстоянием 532 нм. Экспериментально измеренные размеры фокусного пятна составили 0,46 и 0,57 от длины волны фокусируемого света.

## Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, гранта Президента РФ поддержки ведущих научных школ (НШ-4128.2016.9) и молодого кандидата наук (МК-9019.2016.2), а также грантов РФФИ (15-07-01174, 15-47-02492, 16-29-11698, 16-47-630483).

## Литература

- [1] Zhan, Q. Cylindrical vector beams: from mathematical concepts to applications / Q. Zhan //Adv. Opt. Photon. 2009. Vol. 1. P. 1-57.
- [2] Hao, X. Phase encoding for sharper focus of the azimuthally polarized beam / X. Hao, C. Kuang, T. Wang, X. Liu // Opt. Lett. 2010. Vol. 35. P. 3928-3930.
- [3] Qin, F. Shaping a Subwavelength Needle with Ultra-long Focal Length by Focusing Azimuthally Polarized Light / F. Qin, K. Huang, J. Wu, J. Jiao, X. Luo, C. Qiu, M. Hong // Scientific Reports. – 2015. – Vol. 5. – P. 09977.
- [4] Machavariani, G. Efficient extracavity generation of radially and azimuthally polarized beams / G. Machavariani, Y. Lumer, I. Moshe, A. Meir, S. Jackel // Opt. Lett. - 2007. - Vol. 32. - P. 1468-1470.
- [5] Алфёров, С.В. Экспериментальное исследование фокусировки неоднородно поляризованных пучков, сформированных при помощи секторных пластинок / С.В. Алфёров, С.В. Карпеев, С.Н. Хонина, О.Ю. Моисеев // Компьютерная оптика. – 2014. – Т. 38, №1. – С. 57-64.
- [6] Imai, R. Terahertz vector beam generation using segmented nonlinear optical crystals with threefold rotational symmetry / R. Imai, N. Kanda, T. Higuchi, Z. Zheng, K. Konishi, and M. Kuwata-Gonokami // Opt. Express. – 2012. – Vol. 20. – P. 21896–21904.
- [7] Man, Z. Arbitrary vector beams with selective polarization states patterned by tailored polarizing films / Z. Man, C. Min, Y. Zhang, Z. Shen, and X.-C. Yuan // Laser Phys. – 2013. – Vol. 23. – P. 105001.
- [8] Налимов, А.Г. Отражающий четырёхзонный субволновый элемент микрооптики для преобразования линейной поляризации в радиальную / А.Г. Налимов, Л. О'Фаолейн, С.С. Стафеев, М.И. Шанина, В.В. Котляр // Компьютерная оптика. – 2014. – Т.38, №2. – С. 229-236.
- [9] Man, Z. Tight focusing of quasi-cylindrically polarized beams / Z. Man, C. Min, S. Zhu, X.-C. Yuan // J. Opt. Soc. Am. A. 2014. Vol. 31. P. 373-378.